#### ORGANIC ELECTROLUMINESCENT ELEMENT AND ITS MANUFACTURING METHOD

Publication number: JP2005123094 Publication date: 2005-05-12

Inventor: KIDO JUNJI; MATSUMOTO TOSHIO; NAKADA SOJI;

KAWAMURA NORIFUMI Applicant: KIDO JUNJI: INTERNAT MFG & ENGINEERING SER

Classifications

- International: H01L51/50: H05B33/10: H05B33/26: H01L51/30: H01L51/40: H01L51/52; H01L51/50; H05B33/10; H05B33/26; H01L51/05;

(IPC1-7): H05B33/22; H05B33/10; H05B33/14; H05B33/26

H01L51/50G: H01L51/50J2

Application number: JP20030358401 20031017 Priority number(s): JP20030358401 20031017 Also published as:

EP1524707 (A2)

US2005084713 (A1 EP1524707 (A3) CN1610473 (A)

Report a data error hei

#### Abstract of JP2005123094

PROBLEM TO BE SOLVED: To realize a low drive voltage by lowering of an energy barrier in electron injection from a negative electrode into an organic compound layer irrespective of work function of a negative electrode material.

SOLUTION: On a base plate, (a) a positive electrode layer, (b) an organic structure containing at least one luminous layer, (c) a low-resistance electron transport layer as a mixture layer of an electron-donating metal dopant and an organic compound, (d) an organicmetal-complex-containing layer made by including an organic metal complex compound containing at least one kind out of alkaline metal ion, alkali earth metal ion, and rare earth metal lon, (e) a reaction production layer, and (f) a negative electrode layer are laminated in turn, of which, at least either the positive electrode layer or the negative electrode layer is transparent, and the reaction production layer is produced by oxidation reduction reaction through filming of heat-reducing metal, which can reduce metal ion in the organic metal complex compound into metal in the vacuum on the organic-metal-complex-containing layer. COPYRIGHT: (C)2005, JPO&NCIPI

281 Y. 18 .. .... 74 T TREE -- - - 1 ARTER P

1280

च्यावड

4-166

CONTRACTOR CONTRACTOR

. . ...

--------

Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

(19) 日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報(A)

(11) 特許出願公開番号 特開2005-123094

(P2005-123094A) (43) 公開日 平成17年5月12日 (2005.5.12)

(51) Int.Cl. <sup>7</sup>	FI		テーマコード (参考)			
HO5B 33/22	НО5В НО5В НО5В	33/22 33/22 33/10	В	3K007		
HO5B 33/10			Α			
HO5B 33/14						
HO5B 33/26	HO5B	33/14	A			
	HO5B	33/26	Z			
		審查請求	未請求	請求項の数 22	OL	(全 21 頁)
(21) 出願番号	特顧2003-358401 (P2003-358401)	(71) 出願人				
(22) 出題日	平成15年10月17日 (2003.10.17)		城戸 淳二			
		American 1	山形県米沢市林泉寺3-12-16			
	(71) 出願人 593191350 株式会社アイメス 神奈川県腹沢市桐原町 3 番					
					194 de C	
		(74) 代理人			3 W /6	
		(14) (42)		三 三浦 邦夫		
		(74) 代理人				
		(1) (1)		中山 厳		
	v	(72) 発明者	城戸	淳二		
		山形県米沢市林泉寺3-12-16				
		(72) 発明者	松本	敏男		
			神奈川	県際沢市桐原町	3番地	株式会社で
			イメス	内		
				最終頁に続く		

(54) 【発明の名称】有機エレクトロルミネッセント素子及びその製造方法

### (57)【要約】

【課題】 陰極から有機化合物層への電子注入における エネルギー障壁を低下させることにより、陰極材料の仕 事関数に拘わらず、低駆動電圧を実現する。

「原奈宇原」 基板上に (a) 陽極順 (b) 少なくと も一層の発光層を含んでなる有機構造体。 (c) 電子供 身性金属ドーントと有機かの混合層である低低が電子 輸送限。 (d) アルカリ金属イオン、アルカリ土類心面 イオン及び希工類金属イオンのうちの少なくとも 1種を 含む有酸金属鲱体化合物を含んでなる有機金属鲱体含有 層。 (e) 反応生成順、及び (f) 陰極層、が頃に報節 され、前記陽極層及び前記整極層の少なくとも一方が透 明であり、前記四極層及び前記整極層の少なくとも一方が透 明であり、前記四極層及び前記整極層の少なくとも一方が透 中の金属イオンを真空中で金属に還元してる熱電元性全 属を前記有機金属制作名音層上に成限して酸化显示反応 を起こさせることにより生成されている。

【選択図】 図8



【特許請求の範囲】

【請求項1】

基板上に (a)陽極層、

- (b) 少なくとも一層の発光層を含んでなる有機構造体、
- (c) 電子供与性金属ドーパントと有機物の混合層である低抵抗電子輸送層、
- (d) アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン及び希土類金属イオンのうちの少な
- くとも1種を含む有機金属錯体化合物を含んでなる有機金属錯体含有層、
- (e) 反応生成層、及び
- (f)陰極層、

が順に積層され、

前記陽極層及び前記陰極層の少なくとも一方が透明であり、

前記反応生成層は、前記有機金属鎖体化合物中の金属イオンを真空中で金属に還元しう の熱選元性金属を前記有機金属儲か合有層上に成膜して酸化還元反応を起こさせることに より生成されていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項2】

対向する陽極電極と陰極電極の間に、少なくとも一層の発光層を含む発光ユニットを複数 個有する有機エレクトロルミネッセント素子であって、

前記発光ユニットのそれぞれは少なくとも一層からなる電荷発生層によって仕切られており、

前記電荷発生層は1×10°Ω・cm以上の比抵抗を有する電気的絶縁層であり、

前記陰極電極の前記陽極電極方向に接する層は、

(c)電子供与性金属ドーパントと有機物の混合層である低抵抗電子輸送層、

- (d) アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン及び希土類金属イオンのうちの少な
- くとも 1 種を含む有機金属錯体化合物を含んでなる有機金属錯体含有層、
- (e) 反応生成層、及び
- (f)陰極層、

から構成され、かつ

前記反応生成層は、前記有機金属磐体化合物中の金属イオンを真空中で金属に週元しう 熱熱週元性金属を前記有機金属離体合有層上に成隣して酸化還元反応を起こさせることに より生成されていることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント業子。

[請求項3]

請求項1または請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記反応 生成層は、前記有機金属錯体化合物中の金属イオンを真空中で金属に還元しうる熱選元性 金属を前記有機金属錯体含有層上に成膜して酸化還元反応を起こさせることにより、前記 有機金属錯体含有層と前記院極層との界面に形成されていることを特徴とする有機エレク トロルミネッセント素子。

【請求項4】

請求項1乃至請求項3のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記陰極層は仕事関数4.0 e V以上の仕事関数の金属を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項5】

請求項1または請求項2に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記陰極層は導電性化合物を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項6】

請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記電子供性金属ドーパントのイオン化ポテンシャルが4.0 e V未満であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項7】

請求項1乃至請求項6のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子におい

10

て、前記電子供与性金属ドーパントが、アルカリ金属群、アルカリ土類金属群、希土類金 展群から選択される1種以上の金属であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセン ト素子。

【請求項8】

請求項 1 乃至請求項 7 のいずれか 1 項に記載の有機エレクトロルミネセント素子において 、前記低抵抗電子輸送層を構成する電子與4性金属ドーパントと有機物の混合モル比率が 1:10~10:10範囲内にあることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子

【請求項9】

請求項1万至請求項8のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記低抵抗電子輸送層の比較抗が、1×10<sup>18</sup>Ω・cm未満であることを特徴とする 有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項10】

請求項 9 に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記低抵抗電子輸送層の 比抵抗が、 $1\times 10^2$   $\Omega \cdot c$  m以上かつ  $1\times 10^{10}$   $\Omega \cdot c$  m未満であることを特徴とする 有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項11】

請求項1乃至請求項10のいずれか1項に配載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記有機金属銷作含有層がアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン及び希土 類金属イオンのうちの少なくとも1種を含む有機金属銷作化合物のみから構成されること を特徴とする有機エレクトロルミネッセント案子。

【請求項12】

請求項11に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、有機金属御体化合物の みからなる前記有機層の関厚が10nm以下であることを特徴とする有機エレクトロルミ ネッセント素子。

【請求項13】

請求項1 乃至請求項 1 ののいずれか 1 項に記蔵の有機エレクトロルミネッセント素子において前記有機金属銷体含有層が、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン及び希土類金属イオンとでかるとも1 種の管む有機金属領体化合物と、少なくとも1 種の管子輸送性有機物との混合層であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項14】

請求項13に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前配有機金属錯体化合 物と前記電子輸送性有機物との混合モル比率が1:10~10:1であることを特徴とす る有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項15】

請求項1乃至請求項4のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記反応生成層を形成するために使用される前記熱還元性金属と前記陰極層に使用される金属が同一である有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項16】

請求項175至請求項4のいずれか1項に配級の有機エレクトロルミネッセント来デにおいて、前記熱週元性金属がアルミニウム、シリコン、ジルコニウム、チタン、タングステンより進択されるいずれか1種を含むことを特徴とする有機エレクトロルミネッセント来が

【請求項17】

請求項1乃至請求項5のいずれか1項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記熱週元性金属は、抵抗加熱蒸着法、電子ピーム蒸着法、またはレーザービーム蒸 増法によって成限されている有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項18】

請求項5に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記陰極層が抵抗加熱蒸 着法、電子ピーム蒸着法、またはレーザーピーム蒸着法によって成膜されている有機エレ クトロルミネッセント素子。

【請求項19】

請求項5に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記陸極層がスパッタ法 によって成膜されており、前記スパッタ法に使用されるスパッタ装置は、所定距離隔する 対向配置した一対のターゲットの各々の周辺の前方に電子を反射する反射電極を設けると ともに、磁界発生手段により各ターゲットの周辺部の近傍にその面に平行な部分を有する 平行磁界を形成した対向ターゲット式スパッタ装置である有機エレクトロルミネッセント 素子。

【 請求項20】

請求項 1 乃至請求項 4 のいずれか 1 項に配載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記熱選元性金属と、前記陰極層を形成する金属がいずれも仕事関数 4. 〇 e V 以上の仕事関数金属であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子。

【請求項21】

請求項 1 乃至請求項 5 のいずれか 1 項に記載の有機エレクトロルミネッセント素子において、前記熱選元性金属と、前記陰極層を形成する導電性金属化合物がいずれも仕事関数 4 〇 e V以上の仕事関数金属であることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子

【請求項22】

基板上に陽極層を形成する陽極層形成工程と、

前記陽極層上に、少なくとも一層の発光層を含んでなる有機構造体を形成する有機構造 体形成工程と、

前記有機構造体上に、電子供与性金属ドーパントと有機物の混合層である低抵抗電子輸送層を形成する低抵抗電子輸送層形成工程と、

前記低抵抗電子輸送層上に、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン及び香土類 金属イオンのうちの少なくとも1種を含む有機金属顕像化合物を含んでなる有機金属鮮体 合有層を形成する有機金属鎖体合有層形成工程と、

前記有機金属錯体化合物中の金属イオンを真空中で金属に還元しうる熱還元性金属を前記有機金属錯体含有層上に蒸着して反応生成層を形成する反応生成層形成工程と、

前記反応生成層上に仕事間数4.0 e V以上の仕事関数の金属もしくは導電性化合物からなる酸極層を形成する陰極層形成工程と、を有することを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子の製造方法。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0001]

本発明は、平面光源や表示素子に利用される有機エレクトロルミネッセント素子 (有機 エレクトロルミネッセンス素子。以下、「有機 B L 素子」、もしくは単に「素子」と略す 。) に関するものであり、特に酸極から発光層を含む有機構造体へ電子を円滑に注入する ために設けられる電子注入層と電子輸送層に関するものである。

【背景技術】

[0002]

[0003]

このような高効率素子を開発する上で、陰極からの電子や陽極からのホールをエネルギー障壁なく有機層に注入する技術は重要な要素として認識されている。

20

50

40

50

[0004]

前述のTangらは基本的に絶縁物とみなされる有機化合物に対して、金属電極から 電子を注入する際に問題となるエネルギー障壁を低下させるため、仕事関数の小さいMg (マグネシウム、仕事関数: 3.6 e V (1 e V = 1.60218×10<sup>-19</sup> J) (仕事 関数値はCRC Handbook of Chemistry and Physic s, 64th EDITIONより転載。以下、同様)を使用した。その際、Mgは酸化 しやすく、不安定であるのと、有機表面への接着性に乏しいので、比較的安定で仕事関数 も高く、しかも有機表面に密着性の良い Ag (銀、仕事関数: 4.6 eV) と共蒸着によ り合金化して用いた。該合金組成の採用に至るまでの経緯はKODAK社の特許に詳細に 記載されている。

[0005]

当初、KODAK社の特許(米国特許第4,356,429号もしくは米国特許第4, 539,507号)には、有機 E L 素子の陰極に有用な低仕事関数金属(A low w ork function metal) として、Al、In、Ag、Sn、Pb、Mg 、Mn等の金属を例示しており、具体的な仕事関数値の記載によって低仕事関数金属の定 ・ 義をしていなかった。しかし、その後の特許(米国特許第4、885,211号、米国特 許第4、720、432号もしくは米国特許第5、059、862号)では、陰極に使用 される金属の仕事関数は低ければ低いほど、必要とされる駆動電圧も低くなることを記載 したうえで、4.0eV以下の仕事関数値を有する金属を低仕事関数金属と定義し、4. 0 e V 以上の金属はむしろ化学的に不安定な4.0 e V 以下の低仕事関数金属と混合し合 金化することで、該合金陰極に化学的安定性を付与する目的で使用することを記載してい る。この安定化金属は高仕事関数第2金属(higher work function second metal)と表現され、その候補となる金属に、当初は低仕事関数金 属(A low work function metal)として挙げられていたAl 、Ag、Sn、Pbが含まれており、開発初期の試行錯誤の過程が垣間見られる。また、 KODAK社の上記一連の特許中では、最も仕事関数の低いアルカリ金属については、そ の原理的優位性を認めつつも、素子を安定駆動させるには反応性が高すぎるので陰極金属 の候補から除外するとしている。

[0006]

凸版 印刷株式会社のグループ (第51回応用物理学会学術講演会、講演予稿集28A-PB-4、1040頁)及びパイオニア株式会社のグループ (第54回応用物理学会学術 講演会、講演予稿集29p-ZC-15、1127頁)は、Mgよりさらに仕事関数が小 さく(低く)、KODAK社がその特許請求項から除外したアルカリ金属のLi(リチウ ム、仕事関数: 2.9 e V) を用い A 1 (アルミニウム、仕事関数: 4.2 e V) と合金 化することにより安定化させ電子注入陰極として用いることにより、Mg合金を用いた素 子より低い駆動電圧と高い発光輝度を達成している。また、本発明者らは有機化合物層上 にリチウムを単独で10 Å程度に極めて薄く蒸着し、その上から銀を積層した二層型陰極 が低駆動電圧の実現に有効であることを報告している (IEEE Trans. Elec tron Devices, 40, 1342 (1993)).

[0007]

さらに、長近では本発明者らはリチウムなどのアルカリ金属、ストロンチウムなどのア ルカリ土額金属、サマリウムなどの希土類金属を、陰極金属中ではなく、陰極に接する有 機層中にドーピングすることにより、駆動電圧を低下させることに成功した(「Appl . Phys. Lett. 73 (1998) 2866 Appl. Phys. Lett. 7 3 (1998) 2866」、「SID97DIGEST·P775」、特開平10-27 0171号、対応米国特許6,013,384号)。これは電極に接する有機層中の有機 分子を金属ドーピングによりラジカルアニオン状態とし、陰極からの電子注入障壁を大幅 に低下させたためと考えられる。この場合は、陰極金属としてアルミニウムのように仕事 関数が4.0eV以上の高仕事関数金属を使用しても駆動電圧を低くすることができるば かりでなく、ITOのように従来は陽極として使用され、陰極には最も不向きであるとさ

れてきた電極材料でも発光素子として駆動することも確かめられている(特願2001-142672号)。

#### [0008]

またさらに本発明者らは特開平11-233262号、または特開2000-18274号において、陸極電極に接する部分の有機層を、アルカリ金属イオン、アルカリ土質を属イオン、糸土類金属イオンの少なくとも1種を含有する有機金属針体化合物によって構成し、かつ陸離極電機材料が、該混合層中の有機金属錯体化合物中に含有されるアルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオンを真空中において金属に週元しうる熱週元性金属からなることを特徴とする有機エレクトロルミネッセント素子を提案した「「The 10th International Workshop on Inorganic And Organic Electroluminescence P. 61」、「Jpn. J. Appl. Vol. 41 (2002) pp L800-L803 J、「Japan Society of Applied Physics 59th Automun Meet. 1998 Ext. Abstr. (p. 1086)」)。 [0009]

この構造の電子往入層の場合、アルミニウムやジルコニウム等の影遷元性金属が真空環境下での蒸醤にないて、該有機金属鎖体化合物上に原子状で(つまり反応活性な状態で入り飛来し、化合物中の金属イオンを金属状態に選元、遊離させることができ、さらに変元、遊離した金属はその近傍に存在する電子輸送性有機物を1 n ー s 1 t u でドーピングの子はで、遊売(ここでは L e w i s の定義による還元のことであり、電子の受積物をラジカルとになり、前配の直接的金属ドーピングの手法と同様に該電子輸送性保御をラジカリオン化している。つまら、この手法においては「アルミニウムは従来のように仕事関数にはおいたのではなく、東空中における熱還元性という、そのままた、1 生業者間では知られていなかった新規なアイディアに基づいて選択されている。また、2 れら熱還元性金属の仕事関数値はアルミニウム(4 ・02 e V)、シリコン(4 ・08 e V)、ジルコニウム(4 ・00 e V以上の値を有し、化学的に安定な金属であることが重要な要素である。

#### [0101

このような、電子注入技術における歴史的変遷をみても理解されるように、有機エレクトロルミネッセント素子開発においては、電子注入電極、もしくは陸極界面の電子注入層形成法の改良は、絶え間なく行われてきており、結果として発光効率の劇的な改善や、低電圧駆動化を可能としてきたために、現在においては有機 BL素子の性能向上のための重要な要素技術として認識されるに至っている。

#### [0011]

ここで、改めてこれら電子注入技術のそれぞれが持っていた特徴、欠点について列挙すれば以下のようにまとめられる。

#### [0012]

まず、MgやLIを含む合金電極においては、依然として電極の酸化等による素子劣化 が起こる上、有機物圏に対しての電子注入特性のみではなく、配線材料としての機能も考 慮しなければならないので、合金電極では電極材料選択において制限を受ける。

# [0013]

本発明者5の二層型陰極では、Li層の厚みが20人以上では陰極機能しないうえ(IEEE Trans. Electron Devices, 40, 1342(1993) 、 極めて薄い10人程度のLiの蒸着は膜厚制御が困難であり素子作製の再現性に問題がある。

#### [0014]

また、本発明者らの陰極金属に接する部分の有機層を金属でドーピングする方法においては、使用される電子輸送性有機物とドーピングする金属の種類の組み合わせの選択が重

要であり、適切に選択された組み合わせでは、該 ドーピング層の膜厚を当業者にとって常識外に(つまり 2 0 0 0  $\lambda$ 以上に)、厚くしても駆動電圧が全く上昇  $\lambda$ 以ないという特徴があり、特別 2 0 0 1 - 1 0 2 1  $\lambda$  5 号、第6 0 回秋期応用物理学会講演後  $\lambda$  0 0 0  $\lambda$ 以上に)、厚くしても駆動電圧が全く上昇  $\lambda$  4  $\lambda$  2 p - N - 6、1 0 7 9 頁)、素子設計の自由度の観点や、電極間短絡の危険性低減の制点から、今までのところ最も有効な電子柱入輸送層をいうことができる。しかしなから、一方、これまでの本発明者 5 の検討では、陰極金属 2 性有機物をラジカルアニオン化するために、すでに自らはカチオン化して(つまり酸化状態になって)が定定状態にとるめに、すでに自らはカチオン化して(つまり酸化状態になって)が完全にあるめに、すでに自らはカチオン化して活性な運輸金階域との界面に発生で洗りにあるも懸念される。つまりドーピングされる金属は、前途のようにアルカリ金属を代表といると、活性な性質を有するので、陰極界面に(後化状態ではなく)金属状態で遊走といると、上述の合金電板と同様に大気中の酸素や水分と速やかに反応するため、素子の不安定化を引き起こすことが懸念される。

#### [0015]

てのような状態は次のように表わすことができる。有機局がアルカリ金属等の活性金属をドーピングされた状態は、アルカリ金属を代表とする金属原子Mとドーピングされた病態のサービングをれた有機分子のが、 M + O  $\rightarrow$  M + O  $\rightarrow$  と表される電荷移動館体(Charge Transfer complex:C-T complex)の状態で存在しているが(前記Appl. Phys. Lett. 73(1998)2867参照)、この状態である層上に熱遷元性金属のアルミニウム(Al)が蒸養されると、その真空中での週元力によって、 M  $\rightarrow$  + O  $\rightarrow$  Al  $\rightarrow$  M + O  $\rightarrow$  Al  $\rightarrow$  N  $\rightarrow$  O  $\rightarrow$  Al  $\rightarrow$  C  $\rightarrow$  C

### [0016]

また、陰極電極に接する部分の有機層を、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオンの少なくとも1種を含有する有機金属錯体化合物によって構成かつか、または核有機金属は化合物と電子輸送性有機物との混合層によって構成の一致、または核有機金属イオン、アルカリ土質金属イオン、各土質金属イオンとのような熱遷元性金属を使用することで、該有機金属イオンを物理に含有されるアルカリ金属イオンとのような熱遷元性金属を使用することで、該有機金属イオンを物理に含物中に含有されるアルカリ金属イオン、和土質金属イオンを含め中に含有されるアルカリ金属イオンとの1、1000円 1000円 1000円

## [0017]

【特許文献1】特開2001-102175号公報

【特許文献2】特開2000-182774号公報

【特許文献3】特開平11-233262号公報

【特許文献4】特開平10-270171号公報

【特許文献 5】米国特許第4、356、429号明細書

【特許文献 6】米国特許第4,539,507号明細書

【特許文献7】米国特許第4,885,211号明細書

【特許文献 8】米国特許第4、720、432号明細書

【特許文献9】米国特許第5、059、862号明細書

- 【特許文献10】米国特許第6,013,384号明細書
- 【非特許文献1】第51回応用物理学会学術講演会、講演予稿集28A-PB-4、10 40頁
- 【非特許文献 2 】 第 5 4 回応用物理学会学術講演会、講演予稿集 2 9 p Z C 1 5 、 1
- 【非特許文献3】第60回秋期応用物理学会、講演予稿集No.3、4p-N-6、第1079頁
- 【非特許文献4】IEEE Trans. Electron Devices, 40, 1342 (1993)
- 【非特許文献 5】 Appl. Phys. Lett., 51, 913 (1987)
- 【非特許文献6】The 10th International Workshop on Inorganic And Organic Electroluminesc
- ence, 第61頁

127頁

- 【非特許文献7】 Jpn. J. Appl. Vol. 41 (2002) pp L800-L803
- 【非特許文献8】 Japan Society of Applied Physics ,59th Autumn Meeting 1998 Ext. Abst (第1086 頁)

#### 【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

- [10018]
- 本発明は、以上の事情に鑑みてなされたものであり、その目的は陰極から有機化合物層への電子注入におけるエネルギー牌壁を低下させることにより、陰極材料の仕事関数に拘わたず、低駆動電圧を実現することである。 [0019]

#### [0020]

【課題を解決するための手段】

10

[0021]

本発明の有機エレクトロルミネッセント素子においては、基板上に(a)陽極層 (b)少なくとも一層の発光層を含んでなる有機構造体、(c)電子人生性金属ドーパントと有機物の混合層である低抵抗電子物送器、(d)アルカリ金属イオン、アルカリ土 現イオン及び希土類金属イオンのうちの少なくとも1種を含む有機金属館体化合物を含んでなる有機金属館体化合物を含んである有機金属館が含有層。(e)反応生成層、及び(f)除極層、が順に積層され、前記開機層及が高記除極層の少なくとも一方が透明であり、前記反応生成層は、前記有機の単位、前記をは、前記では、前記では、前記では、前記では、前記では、10002000円では、1000201円では、1000200円では、100020円では、100020円では、1000200円では、

反応生成層は、有機金属鎖体化合物中の金属イオンを真空中で金属に還元しうる熱還元 性金属を有機金属鎖体含有層上に成膜して酸化還元反応を起こさせることにより、前配有 機金属鎖体含有層と前配磁極層との界面に形成されていることが好ましい。

[0024]

陰極層は、仕事関数 4.0 e V以上の仕事関数の金属または導電性化合物を有することが好ましい。

[0025]

電子供与性金属ドーパントのイオン化ポテンシャルは、4.0 e V 未満であることが好ましく、電子供与性金属ドーパントは、アルカリ金属群、アルカリ土類金属群、希土類金属群、5世紀の金属であることが好ましい。また、低抵抗電子輸送層を構成する電子供与性金属ドーパントと有機物の混合モル比率は、1:10~10:10範囲内にあることが好ましい。

[0026]

低抵抗電子輸送層の比抵抗は、 $1 \times 10^{10} \Omega \cdot c$  m未満であることが好ましく、 $1 \times 10^{2} \Omega \cdot c$  m以上かつ  $1 \times 10^{10} \Omega \cdot c$  m未満であるとなおよい。

[0027]

有機金属錯体含有層は、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン及び希土類金属 イオンのうちの少なくとも1種を含む有機金属錯体化合物のみから構成されることが好ま しく、有機金属錯体化合物のみからなる有機層の膜厚は、10nm以下であることが好ま しい。

[0028]

[0029]

反応生成層を形成するために使用される熱選元性金属は、アルミニウム、シリコン、ジ ルコニウム、チタン、タングステンより選択されるいずれか1種を含むことが好ましい。 【0033】

10

20

40

40

陰極層、熱運元性金属及び/または導電性金属化合物は、抵抗加熱蒸着法、または電子 ビーム蒸着法、またはレーザービーム蒸着法のいずれで成膜してもよい。

### [0031]

陸極層、熱還元性金属及び/または導電性金属化合物は、スパッタ法によって成膜されていることが好ましく、前記スパッタ法に使用されるスパッタ装置は、所定距離隔でて対向配置した一対のターゲットの各々の周辺の前方に電子を反射する反射電極を設けるとともに、磁界発生手段により各ターゲットの周辺部の近傍にその面に平行な部分を有する平行磁界を形成した対向ターゲット式スパッタ装置であることが好ましい。

#### [0032]

熱還元性金属、及び、陰極層を形成する金属または導電性金属化合物は、いずれも仕事 10 関数 4.0 e V 以上の仕事関数を有することが好ましい。

#### [0033]

本発明に係る有機エレクトロルミネッセント素子の製造方法においては、基板上に隔極層を形成する陽極層形成工程と、陽極層上に、少なくとも一層の発光層を含んでなる有機造体を形成する有機構造体形成工程と、有機構造体上に、電子供与性を属ドーパントと有機物の混合層である低抵抗電子輸送層を形成する低抵抗電子輸送層上に、アルカリ金属イオン、アルカリ土類金属イオン及び希土類金高層をイオンのうちの少なくとも1種を含む有機金属鎖体化合物を合物を含有機金属鎖体含有層を形成する有機金属鎖体含有層形成工程と、有機金属銀体化合物中の金属イオンを真空中で金属に還元しうる熱選元性金属を有機金属針を有層上に蒸着して反応生成層を形成する反応生成層形成工程と、反応生成層上に共業して反応生成層を形成する反応生成層形成工程と、反応生成層上に共業目の表現しては導電性化合物からなる陰極層を形成する陰極層形成工程とを有する。

#### 【発明の効果】

### [0034]

本発明は、本発明者らがこれまで概意検討して採用してきた、異なる種類の電子注入層や電子輸送層を組み合わせることにより、陰極層からの電子注入時のエネルギー障壁を低減するとともに、注入された電子が発光層に到遠するまでの電気抵抗を接減するための低抵抗電子輸送層を陰極金属層から、反応生成層によって隔てられた層として設け、結果的に該層中には、アルカリ金属等の反応活性な金属が、マベアカチオン状態(酸化状態)として存在し、アルミーシムのような経来から低抵抗配線材料として使用れてきた、で化学的に安定な金属を使用した時にも、低駆動電圧が実現できて、かつ駆動寿命も、保存寿命も長期にから、表示素子や光線として有効利用が可能である。

# 【発明を実施するための最良の形態】

#### [0035]

図1 は、本発明による有機 E L 素子の 1 実施形態を示す機式関である。ガラス基板 (透明基板) (基板) 1 上には、順に、透明電極層 2、有機物からなる正孔 (ホール) 輸送層 3、有機物からなる光光層 4、金属ドーピング層 5、有機金属網依含有層 6、反応生成層 7、及び陰極層 (陰極) 8が積層されている。これらの要素 (層) のうち、透明電極層 2 は「限極層 (陽極) に、正孔輸送層 3 と発光層 4 は「発光層を合んでなる有機構造体」に、金属ドーピング層 5 は「低抵抗電子輸送層」とそれぞれ対応している。また、「発光層を含んでなる有機構造体」には正孔往入層やホールブロック層も含みうる。

## [0036]

20

50

は陰極層8に使用される金属として最も有用である。

[0037]

また、陰極材料をITOのような透明電極にして、陰極層8側からも光を取り出したい 場合は、反応生成層7の形成に消費される熱遷元金属の量を必要十分にして、かつ最小限 に制御することで、光が透過可能な膜を反応生成層7として形成し、その後に陰極である 透明電極層2を形成すれば良い。

[0038]

[0039]

また、これらの構造の陰極層と陽極層に挟まれた層の全体を「発光ユニット」として、本発明者らが特膜2002-086599号(特開2003-272860号)に示した「陽極層/発光ユニット)電荷発生層/発光ユニットが電荷発生層で仕切られて構成される、新しい構造の有機EL素子であってもよく、本発明による有機EL素子は、低抵抗電子輸送し、場合に生成層の組み合わせが陰極層側に形成されていれば、その他の層はいかなる素子構成であっても良い。

[0040]

上記、低抵抗電子輸送網ン金属網体含有網ブ反応生成層中の各層に使用される有機物や 低抵抗電子輸送層中にドーピングされる(混合される)金属や反応生成層の形成に使用さ れる熱選元性金属の成膜法は、いかなる薄膜形成法であってもよく、例えば蒸着法やスパ ッタ法が使用できる。 【2004】

また低抵抗電子輸送層である「金属ドーピング層」の作製法は特開平10-27017 1号公報に記載される共業着の手法を用いても良いし、本発明者らが前出の「1EEE Trans.Electron Devices 40. 1342(193)」にお いて示したように、ドーピングしたい有機層上に極薄く(<20名)金属を積層して、結

[0042]

また、上記反応生成層に使用されるアルミニウムやジルコニウム等の熱週元性金属や陰 帳層材料の成膜法も、蒸着法やスパッタ法が使用できるが、真空中における成膜法であれ ぼそれに限定されるものではない。

果的に有機層中に金属原子が拡散した状態を作り出す手法を用いても良い。

[0043]

低抵抗電子輸送層中の電子輸送性有機物として使用できる有機化合物や、金属額体含有層中に使用できる金属館体化合物としては、特に限定はなく、本発明者らがこれまでに開示してきた公開特許明細書中に記載される、前記特開平10-270171号、特開11-251067号、特開2001-182774号、特開2001-24079号、特開2001-152774号、特開2001-24079号、特開2001-152775号等に記載された有機化合物をそのまま使用できる。

[0044]

正孔柱入層、正孔輸送層、正孔輸送性発光層として使用されるアリールアミン化合物類 としては、特に限定はないが、特開平6-25659号公報、特開平6-203963号 公報、特開平6-215874号公報、特開平7-145116号公報、特開平7-24012号公報、特開平7-157473号公報、特開平8-48656号公報、特開平7-157473号公報、特開平8-48656号公報、特開平

7-126226号公報、特開平7-188130号公報、特開平8-40995号公報 . 特關平8-40996号公報、特關平8-40997号公報、特開平7-126225 号公報、特開平7-101911号公報、特開平7-97355号公報に開示されている アリールアミン化合物類が好ましく、例えば、N, N, N', N'ーテトラフェニルー 4 . 4' - ジアミノフェニル、N. N' - ジフェニル-N, N' - ジ (3-メチルフェニル ) - 4, 4' - ジアミノビフェニル、2, 2 - ビス (4 - ジ - p - トリルアミノフェニル ) プロパン、N, N, N', N'-テトラ-p-トリル-4, 4'-ジアミノビフェニル 、ビス (4 - ジー p - トリルアミノフェニル)フェニルメタン、N. N' - ジフェニルー . N' ーテトラフェニルー 4 . 4' ージアミノジフェニルエーテル、 4 . 4' ービス (ジ フェニルアミノ) クオードリフェニル、4-N、N-ジフェニルアミノー(2-ジフェニ ルピニル) ベンゼン、3-メトキシ-4'-N、N-ジフェニルアミノスチルベンゼン、 N-フェニルカルバゾール、1, 1-ビス(4-ジ-p-トリアミノフェニル) -シクロ ヘキサン、1, 1-ビス (4-ジーp-トリアミノフェニル) -4-フェニルシクロヘキ サン、ビス (4-ジメチルアミノ-2-メチルフェニル) -フェニルメタン、N. N. N ートリ (p-h ) ) ) アミン、4-(ジ-p-h ) ルアミノ) -4'-[4 (ジーp-h )リルアミノ) スチリル] スチルベン、N, N, N', N' - テトラフェニルー 4, 4' -ジアミノービフェニルN-フェニルカルパゾール、4,4'-ビス[N-(1-ナフチル ) -N-フェニルーアミノ] ビフェニル、4, 4''-ビス <math>[N-(1-ナフチル)-N-フェニル-アミノl p-ターフェニル、4、4' -ビス [N-(2-ナフチル) - N-フェニルーアミノ] ビフェニル、4. 4' - ビス [N-(3-アセナフテニル) - N-フ ェニルーアミノ] ビフェニル、1,5-ビス[N-(1-ナフチル)-N-フェニルーア ビフェニル、4. 4'' - ピス [N-(1-アントリル) - N-フェニルーアミノ] p-ターフェニル、4、4' ーピス [N-(2-フェナントリル) -N-フェニルーアミノ] ピフェニル、4.4'-ビス[N-(8-フルオランテニル)-N-フェニルーアミノ] ビフェニル、4. 4'ービス[N-(2-ピレニル)-N-フェニルーアミノ] ビフェニ ル、4、4'ーピス [N-(2-ペリレニル)-N-フェニルーアミノ] ピフェニル、4. 4' ーピス [N- (1-コロネニル) - N-フェニル-アミノ] ピフェニル、2,6-ビス (ジーpートリルアミノ) ナフタレン、2, 6-ビス [ジー(1-ナフチル) アミノ 1 ナフタレン、2. 6-ビス [N-(1-ナフチル)-N-(2-ナフチル) アミノ] ナフタレン、4.4''-ビス[N, N-ジ(2-ナフチル)アミノ]ターフェニル、4. 4' -ビス (N-フェニル-N-[4-(1-ナフチル) フェニル] アミノ} ビフェニル 、4、4'-ビス[N-フェニル-N-(2-ピレニル)-アミノ] ビフェニル、2,6 -ビス[N, N-ジ(2ーナフチル)アミノ]フルオレン、4,4''ービス(N, N-ジーp-トリルアミノ) ターフェニル、ビス (N-1-ナフチル) (N-2-ナフチル) アミンなどがある。さらに、従来有機EL素子の作製に使用されている公知のものを適宜 用いることができる。

## [0045]

さらに、正孔注入層、正孔輸送層、正孔輸送性発光層として、上述の有機化合物をポリマー中に分散したものや、ポリマー化したものも使用できる。ポリパラフェニレンビニレンやその誘導体などのいわゆる $\pi$  共役ポリマー、ポリ(N ーピニルカルパゾール)に代表されるホール輸送性非共役ポリマー、ポリシラン類のシグマ共役ポリマーも用いることができる。

#### [0046]

陽極層上に形成する正孔注入層としては、特に限定はないが、銅フタロシアニンなどの 金属フタロシアニン類及び無金属フタロシアニン類、カーボン膜、ポリアニリンなどの導 電性ポリマーが好適に使用できる。さらに、本発明者らが特開平11-251067号( 財応米国特許第6,423,429B2号)や特開2001-244079号(対応米国特許第6,589,673B1号)で示したように、前述のアリールアミン類に酸化剤と してルイス酸分子を作用させ、アリールアミン化合物のラジカルカチオンを形成させて正 孔注入層として用いることもできる。

## 【実施例】 【0047】

以下に実施例を挙げて本発明をさらに詳細に説明するが、本発明はこれにより限定されるものではない。また、実施例と比較するために、発明者らがすで間発色し、開示して応素学を基準例として性で説明する。なお、有機化合物、金属、及び電荷発生層の形成には真空機工社製VPC-400、もしくはアネルバ製真空蒸蓄緩とFTSコーポレーション製NFTSスパッタリング装置を使用した。熱着物質の成膜速度の制御や腰厚の制向(ULVAC(日本真空技術社)製)を使用した成果を手を用いた。業子の物を性原域には、テースレー(KEITHLEY)社ソースメータ2400、トプコンB格型には、ケースレー(KEITHLEY)社ソースメータ2400、トプコンB格型には、使用した。素子作製後、陽極層と陰極層間に直流電圧を0.2 V/2秒、64に1V/2秒の割合でステップ状に印加して、電圧上昇1秒後の輝度及び電流値を測定した。また、ELスペクトルは、浜粉ホトニクスPMA-11オプチカルマルチチャンネルアナライザーを使用して定電流駆動し測定した。

## 【0048】 無準例1

基準例1として、低抵抗電子輸送層(金属ドーピング層)が陰極層と接触して、電子注入層としても機能する特開平10-270171号公報記載の従来の素子作製例について説明する。基準例1は、図2の積層構成の有機EL素子であって、ガラス基板11上に陽極透明電板12としてシート抵抗10Q/□のITO(インジウムースズ酸化物、日本板

硝子社製)がコートされている。その上にホール輸送性を有する下記式: 【化1】

で表わされるαNPDを10<sup>-6</sup> t Torr (1Torr ≒133.32Pa)下で、2 Å /秒の蒸着速度で500 Åの厚さに成膜し、ホール輸送層13を形成する。次に、前記ホ ール輸送層13の上に、発光層14として下記式: 【化2】

40

30

で表されるトリス (8-キノリノラト) アルミニウム錯体層 (以下「AIq」という) をホール輸送層13と同じ条件で400Åの厚さに真空蒸着して形成する。

#### [0049]

さらに、前記発光層4の上に、低抵抗電子輸送層(兼電子注入層)(金属ドーピング層)15として、下記式:

20

30

40

50

[化3]

で表されるパソクプロイン (以下、BCPと記す) とアルカリ金属であるCs (セシウム) をモル比率BCP:Cs=4:1 で共業着し300 Åの厚さに成膜する。つづいて、陰 極層18 として、A1を蒸着速度10 Å/ 秒で1000 Å蒸着する。発光領域は縦0.2 cm、積0.2 cm、積0.2 cm、積0.2 cm、

[0050]

基準例2

基準例2として、低抵抗電子輸送層(金属ドービング層)が存在せず、(e)反応生成 層が電子注入層として機能する特別平11-233262号公報記載の従来の素子作製例 について説明する。基準例2は、図7の積層構成の有機 E L 業子であって、ま事基準例1 と同様の条件で、ガラス基板21上に陽極透明電極22及びホール輸送層23を成膜して ある。次に発光層24として前述の A 1 qを700 &の厚さに形成する。つづいて、有機 金属總体含有層26を形成するために、アルカリ金属のリチウムをイオンとして含有する 有機金属網体化合物として下記式:

[(:4]



[0052]

基準例2の有機E L 素子において、関極透明電極22である1T O と陰極電極28である1との間に、直流電圧を印加し、発光層24(Alq)から緑色発光の輝度を測定した結果を図3、関4、関5、図6において白四角プロット(口)で示す。

[0053]

実施例1

実施例1として、有機金属錯体含有層が有機金属錯体のみから構成される素子について 説明する。図8に示す本実施例の有機EL素子は次のように作製した。まず基準例1と同 様の成膜条件で、ガラス基板31上に隔極透明電極32、ホール輸送層33、発光層34 及び金属ドーピング層(低抵抗電子輸送層)35であるBCPとCsの共蒸着膜を成膜し た。次に、基準例 2 と同様に、有機金属錯体含有層 3 6 である L i q を 2 5 Å の厚さに成 膜した。最後に、 L i q 中の金属イオンを真空中で金属に還元しうる熱還元性金属に0 8 Å 1 (アルミニウム、仕事関数: 4 . 2 e V) を、除極層 3 8 として、蒸着速度 1 0 Å 移で 1 0 0 0 Å 蒸着 した。これにより、有機金属錯体含有層 3 6 と A 1 からなる陰極層 3 8 との界面で酸化還元反応が起き、反応生成層 3 7 が形成される。発光領域は基準例 1 及び 2 と同じく 健 0 . 2 c m、横 0 . 2 c mの正方形状とした。 [ (0 0 5 4 】

実施例 1 の有機 E L 表子において、隔極遮明電極 3 2 である I T O と陰極電極 3 8 である A 1 との間に、直流電圧を印加し、発光圏 3 4 (A 1 q) から緑色発光の輝度を測定した結果を図3、図4、図5、図6において十字プロット(+)で示す。

[0055] 宇施例2

実施例 2 として、有機金属錦体含有層が有機金属錦体化合物と電子輸送性有機物の混合層が6 作製した。まず、基準例 1 と同様の成服条件で、ガラス基板 4 1 上に陽極遠明基板 4 2、ホール輸送層 4 3 及び発光層 4 4 (A 1 q ) を成膜した。次に金属ドーピング層(保抵状金属維金有機・4 5 である。B C P と C s の共滅着限を 2 0 0 人成膜した。さらに、有機の質性を有層 4 6 として、B C P と L 1 q を共蒸着の手法でモル比1:1で10 0 人の厚さで成膜した混合層 4 6 を形成した。最後に、L 1 q 中の金属イオンを真空中で金属に週元しうる熱選元性金属である A 1 を、陰極層 4 8 として、蒸着速度 1 0 入/秒で 1 0 0 人 A 蒸

[0056]

実施例2の素子の場合、有機金属錯体含有層36とA1からなる陰極層38との界面で酸化還元反応が起き、反応生成層47が形成される。発光領域は、基準例1、2及び実施例1と同じく総0.2cm、機0.2cmの正方形状とした。なお、実施例1及び実施例2において、熱還元性金属としてのA1に代えてシリコン、ジルコニウム、チタン、タングステンを用いてもよい。また、アルミニウムの蒸着は、抵抗加熱蒸着法、電子ビーム蒸着法、またはレーザービーム蒸着法のいずれの方法で行ってもよい。さらに、蒸着に代えてスパッタリングによってアルミニウムを成膜してもよい。

[0057]

実施例 2 の有機 B L 素子において、陽極透明電極 1 2 である I T O と陰極電極 1 6 である A 1 との間に、 庭流電圧を印加し、発光層 1 4 (A 1 q) から緑色発光の輝度を測定した結果を図 3、図 4、図 5、図 6において白三角プロット(△)で示す。

[0058]

実施例3

[0059]

本実施例で用いたスパッタ装置は、所定距離隔てて対向配置した一対のターゲットの各々の周辺の前方に電子を反射する反射電極を設けるとどもに、磁界発生手段により各ターゲットの周辺部の近傍にその面に平行な部分を有する平行磁界を形成した、対応サード式スパッタ装置である。なお、ITOの成膜は蒸着によって行ってもよく、蒸着は、抵抗加熱蒸巻法、電子ピーム蒸着法、またはレーザーピーム蒸着法のいずれの方法で行って

10

30

40

40

50

もよい。

[0060]

実施例3の有機E L 素子において、陽極透明電概52であるI T O と透明瞭極電報58であるI T O との間に、直流電圧を印加し、発光層54 (A I q) から緑色発光の彫度を測定した結果を図11、図12、図13、図14において白丸プロット(O) で示す。図11、図12、図13及び図14は、それぞれ、実施例3の素子の電流密度(mA/cm²)一電圧(V) 特性(図11)、輝度(cd/m²) 中電圧(V) 特性(図12)、電流効率(cd/m/4) 特性(図14)を示すものである。この素子の発光間始電圧(tu rn-o nvo 1t age)は2c 4Vであり、IT Oの層を機極層に接する層として設切れば、電子注入に際してのエネルギー障壁を実質的に0とすることができることが分かった。

[0061]

参考例

参考例として、低抵抗電子輸送層等の比抵抗 (Ω・cm) を測定した。比抵抗 (Ω・cm) の測定法は、被測定物の比抵抗の値 (レンジ) によって 2 種類の方法で測定した。 【0062】

第1の測定法は、比較的比抵抗の大きい物質に対して適当とされる方法であって、被測定物の蒸着薄膜を電極で狭持した形態(図15及び図16に示すサンドイッチ構造の批販抗評価用票子)で測定を行う(サンドイッチ法)。印加電圧(V)と被測定物薄膜の膜厚(c m)(つまり電椎間距離)から得られる電場 E(V/c m)と、観測電流(A)と電流が流れる領域の断面積(c m²)とかち得られる電流密度(A/c m²)との比 (V/c m)/(A/c m²) = ( $\Omega$ ・c m)から比抵抗を算出した。

[0063]

比抵抗評価用素子は、2mm幅のITO (またはAI) 電極62上に被測定物69を所望の誤厚になるように蒸着し、最後に2mm幅のアルミニウム電極68を1TO電極62 と直交するように成膜することによって作製した。

[0064]

第2の測定法は、比較的比抵抗の小さい物質に対して適当とされる方法で、並置構造の比抵抗評価用素子を用いて測定する(並置法)。すなわち、図17及び図18に示したように、まず基板100 上の同一平面上に予め陽極層101、陰極層108 となる電極方に、まず基板109 )隔でて成膜されたものを用意しておく。次に、その上から被測定物109 の蒸磐薄膜を所定の閉口幅(W(cm))を有するエリア足用金属で入りを介して、所定の原厚(11 (cm) を成膜する。この自合得られる電場 11 (V/cm) は、可加電圧(V)を電極間距離(12 (cm) で除して算出され、電流密度(13 /cm) は観測電流(14 )を電流が流れる領域の断面積(15 の場合は17 /cm) は、記れる。このようにして得られた値から、前記のサンドイッチ構造の場合と同様に、比抵抗(10 ·cm) を算出した。

[0065]

被測定物の種類は、ITO (透明電極材料)、CsとBCPの共蒸着膜 (Cs:BCP=1:1 (モル比)、本発明の低抵抗電子輸送層)、LiとAlqの共蒸着膜 (Ll:Alq=1:11(モル比)、本発明の低抵抗電子輸送層)、 $\alpha$ —NPD (ホール輸送性のアリールアミン)、Alq、(発光材料)である。ITOは、並関構造の比抵抗評価用業子で測定し、CsとBCPの共蒸着膜、LlとAlqの共蒸着膜、 $\alpha$ —NPD及びAlq,は、サンドイッチ構造の比抵抗評価無業子で測定した。

[0066]

図19に比抵抗の測定結果を示す。図中の○、一、 | 、□及び△印は、それぞれ、被測定物が1TO、1TO/Cs:BCP/AI、AI/Li:AI q<sub>3</sub>/AI、AI/AI q<sub>3</sub>/AI及び1TO/α-NPD/AIの場合の測定結果である。

30

40

50

(17)

[0067]

図19より、各被測定物の被抵抗は以下のようになった。

ITO (図19中の○印): 4×10<sup>-4</sup> Q·cm (並置法

】 ITO/Cs:BCP/Al (図19中の一印) : 2×10<sup>5</sup>Ω・cm (サンド イッチ法)

A l / L i : A l q 3 / A l (図19中の|印): 2×10<sup>9</sup>Ω·cm(サンド

イッチ法) A 1/A 1  $q_3/A$  1 (図1 9 中の口印) :  $6 \times 10^{13} \Omega \cdot cm$  (サンド

 $A = 1 / A = 1 q_3 / A = 1 (図 = 9 + 9 0 0 0 0 )$  . 0 < 1 0 0 0 0 0 0 0 . 1 < 3 < 1 0 0 0 0 0 0 .

 $ITO/\alpha-NPD/AI$  (図I9中の $\Delta$ 印):  $I\times I0^{13}$ Ω・cm (サンドイッチ法)

[0068]

図 1 9 に示される通り、本発明の低抵抗電子輸送層である金属ドーピング層(| 印とー 印)は、電場と電流(電流密度)が比例するオーム電流の性質を示し、それらの比抵抗は  $1\times 10^2\Omega$ ・c m以上で $1\times 10^{10}\Omega$ ・c m以下の範囲にある。一方、 $\alpha$  - N P D ( $\triangle$  印) や A 1 q  $_3$  ( $\Box$   $\Omega$ ) のような純粋な有機物は電場と電流が比例しないため、元米比抵抗値を定義できないが、電流が観測され始めるところで得られたデータから算出した。

[0069]

上述の基準例 1 と基準例 2 の結果を比較すると、より低電圧で駆動できるのは基準例 1 の方であり、一方、電流効率(量子効率)は基準例 2 の方が高い。実施例 1 と実施例 2 の 6 取扱力率(量子効率)とほぼ同等の値を維持したままであり、また低電圧駆動特性は基準例 1 の特性に近い。後って本発明の素子は、本発明者らがこれまで検討し間示してきた電子注入または電子輸送圏の特長を併せ持つ性質を有することが、た。また有機 E L 業子の駆動寿命は、電流密度に略比例 することが、ら高い駆動寿命を有する。

【図面の簡単な説明】

[0070]

【図1】本発明の1実施形態に係る有機EL素子の構成を示す模式図である。

【図2】基準例1の有機EL素子の構成を示す模式図である。

[図3] 基準例1、基準例2、実施例1及び実施例2の有機EL素子の電流密度(mA/cm²)対電圧(V)特性を示す図である。

[図4] 基準例1、基準例2、実施例1及び実施例2の有機EL素子の輝度(cd/m²)対照圧(V)物性を示す図である。

【図5】基準例1、基準例2、実施例1及び実施例2の有機EL素子の電流効率 (cd/

A) 対電流密度 (m A / c m<sup>2</sup>) 特性を示す図である。 【図 6】基準例 1、基準例 2、実施例 1 及び実施例 2 の有機 E L 素子の電力効率 (1 m /

「図7】 基準例2に係る有機 EL素子の構成を示す模式図である。

W ) 対細度 ( c d / m<sup>2</sup> ) 特性を示す図である。

【図8】実施例1に係る有機EL素子の構成を示す模式図である。

【図9】実施例2に係る有機EL素子の構成を示す模式図である。

【図10】実施例3に係る有機EL素子の構成を示す模式図である。

【図 1 1 】 実施例 3 に係る有機 E L 素子の電流密度 (m A / c m <sup>2</sup>) 対電圧 (V) 特性を 示す図である。

【図12】実施例3に係る有機EL素子の輝度 (cd/m²) 対電圧 (V) 特性を示す図である。

【図13】実施例3に係る有機EL素子の電流効率 (cd/A) 対電流密度 (mA/cm<sup>2</sup>) 特性を示す図である。

【図14】実施例3に係る有機EL素子の電力効率(1m/W)対輝度(cd/m²)特

## 性を示す図である。

【図15】サンドイッチ法による比抵抗評価用素子を示す平面図である。

【図16】図15の線XVI-XVIにおける断面図である。

【図17】 並置法による比抵抗評価用素子を示す平面図である。

【図 1 8 】図 1 7 の線 X V I I I I - X V I I I における断面図である。

【図19】被測定物の比抵抗の測定結果を示す図である。

【符号の説明】

## [0071]

1、11、21、31、41、51 ガラス基板

2、12、22、32、42、52 (陽極)透明電極層

3、13、23、33、43、53 ホール輸送層

4、14、24、34、44、54 発光層

5、15、35、45、55 金属ドーピング層

6、26、36、46、56 有機金属錯体含有層

7、27、37、47、57 反応生成層

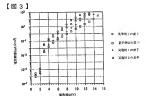
8、18、28、38、48、58 陰極層

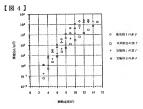


ガラス基板

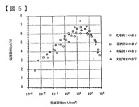
# [図2]



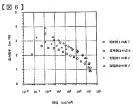




[図7]

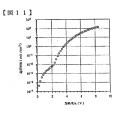




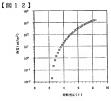


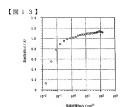


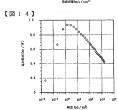


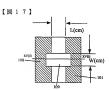




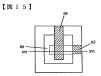


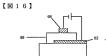


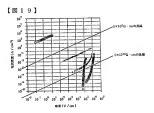












## フロントページの続き

(72)発明者 仲田 壮志

神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社アイメス内

(72)発明者 川村 憲史

神奈川県藤沢市桐原町3番地 株式会社アイメス内

Fターム(参考) 3K007 AB03 AB06 AB08 AB11 CB01 CC00 DB03 FA00